



P-MEC Japan 2016（医薬品原料機器・装置展）出展のお知らせ

会 期：2016年4月20日(水)～22日(金) 10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1）

出展場所：東1ホール No. U-40

U R L：<http://www.cphi-japan.com/info/p-mec.html>



※上記 URL のトップページより事前来場登録（招待券請求[無料]）をすることができます

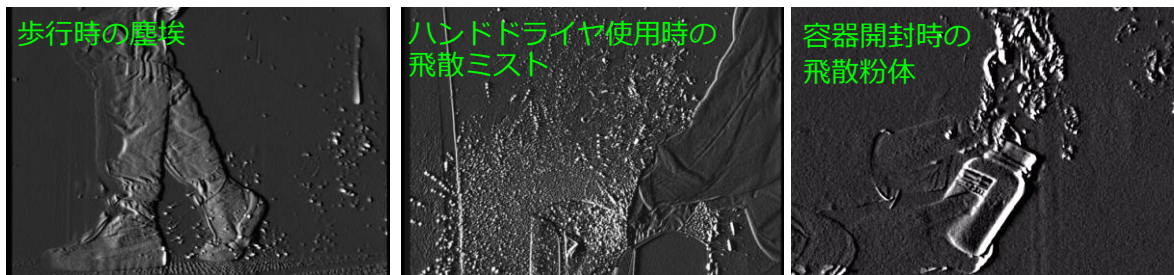
世界最高水準の「微粒子可視化システム」を出展します



可視化光源 **パラレルアイH**

超高感度カメラ **アイスコープ**

微粒子可視化システムによる撮影事例（当社ホームページに動画が掲載されています）



歩行時の塵埃

ハンドドライヤ使用時の
飛散ミスト

容器開封時の
飛散粉体

新製品も出展します



表面観察用ツール **Dライト**

観察例：キーボードの汚れ

当社の微粒子可視化システムは、超高感度カメラと独自開発の可視化光源を組み合わせた、80ナノメートルの浮遊微粒子をリアルタイムに映像化できる世界最高水準の可視化装置です。

国内外にて、システムの販売や、システムを利用した受託サービス（製造ライン内の微粒子や気流の可視化調査、製造装置の内部や周辺のクリーン度評価、各種設備性能の評価など）を展開中です。

本展では、機材や各種ソフトウェア、撮影事例動画を展示し、実際に微粒子の可視化をご体感頂けるようにデモコーナーを設置します。また、販売開始直後から大変好評で、多くの業界より問合せを頂いているまったく新しいタイプの表面観察用ツール「Dライト」も展示します。この機会に是非会場をご覧ください。

＜本件に関する問い合わせ先＞

ビジュアルソリューション事業部 Tel: 03-3639-2206 E-mail: viest@snk.co.jp

～ 詳しくはホームページをご覧ください <http://www.snk.co.jp/particle> ～